

## 産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2010年 5月公開分(54件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2010-099335	立体視機能検査方法	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2010-100592	含フッ素化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2010-101067	立体トラス接合具および方法	独立行政法人産業技術総合研究所 清水建設株式会社 サンウッド工業株式会社
4	特開2010-101672	被検査体における形状検査を行う方法及び被検査体における形状検査装置	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2010-103047	新規プロトン伝導体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2010-103325	プラズマ中に存在する活性種の測定装置及び方法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2010-103555	可変抵抗素子	シャープ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2010-103556	回路基板、電子装置、及び回路基板の製造方法	富士通株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2010-104350	未分化細胞の選別方法	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2010-104878	低級オレフィン製造用触媒、その製造方法及びこれを用いた低級オレフィンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 丸善石油化学株式会社
11	特開2010-104909	低級オレフィン製造用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所 丸善石油化学株式会社
12	特開2010-104928	マイクロリアクター用反応管及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2010-104933	排ガス処理触媒およびこれを使用する排ガス浄化装置	独立行政法人産業技術総合研究所 三菱重工業株式会社
14	特開2010-105846	アルミナ多孔質自立膜及びその製造方法	川研ファインケミカル株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2010-106101	近赤外光を吸収するポリシラン薄膜及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2010-106735	発熱体、内燃機関の排気浄化装置、及び燃料改質装置	株式会社コモテック 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2010-108793	全固体リチウム二次電池用正極および全固体リチウム二次電池	出光興産株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 日立造船株式会社
18	特開2010-109175	固体メモリ	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2010-109177	固体メモリの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2010-109683	再構成可能集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2010-109994	二重絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いたゲート回路、SRAMセル回路、多入力CMOSゲート回路、CMOS-SRAMセル回路、集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2010-110669	プラズマ溶射装置	株式会社日本セラテック 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2010-110671	改質用ペロブスカイト担持Ni触媒材料及びこれを用いる合成ガス製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2010-110715	光触媒浄化装置	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2010-111119	製膜装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ジー・イー・エス

No.	公開番号	発明の名称	出願人
26	特開2010-111869	コハク酸系共重合体の製造方法とその共重合体	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2010-112867	振動又は弾性波検出装置	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2010-112888	検出センサ	独立行政法人産業技術総合研究所 オリンパス株式会社
29	特開2010-113284	有機ナノチューブを有する偏光用組成物及び偏光子	独立行政法人産業技術総合研究所 チッソ株式会社
30	特開2010-113760	磁気記録媒体、磁気記録再生装置及び磁気情報記録方法	シャープ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2010-113851	リチウム二次電池用負極材、その製造方法およびリチウム二次電池	東海カーボン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2010-114031	燃料電池MEAの材料リサイクル方法	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2010-114261	磁気メモリ、および磁気メモリへの情報記録方法	シャープ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2010-115132	ルシフェリン-ニールシフェラーゼ反応における発光強度の低下を抑制するための組成物及び方法	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2010-115404	パーソナルビークル	アイシン精機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2010-116293	多孔性アルミノリン酸トリエチルアミン結晶及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2010-116330	フッ化シクロブタン化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2010-116381	紫外線に対する感受性制御剤	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2010-117175	画像処理システム、画像処理方法、プログラムおよび記録媒体	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2010-117184	検出センサ	独立行政法人産業技術総合研究所 オリンパス株式会社
41	特開2010-117350	モーター結合物質を用いた未分化細胞標識方法	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2010-117968	再構成可能論理デバイスの論理プログラムデータ保護システム及び保護方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2010-105864	過酸化水素の連続分解方法	独立行政法人産業技術総合研究所
44	WO2008/084869	一分子型生物発光可視化プローブ	独立行政法人産業技術総合研究所
45	WO2008/090816	マスクパターン設計方法および半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
46	WO2008/090864	シリコン基板の製造装置、製造方法及びシリコン基板	独立行政法人産業技術総合研究所
47	WO2008/093731	燃料電池用電極触媒およびこれを用いた燃料電池	独立行政法人産業技術総合研究所
48	WO2008/093734	ソースファイル管理システム	独立行政法人産業技術総合研究所
49	WO2008/093834	固体撮像装置およびその製造方法	ローム株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
50	WO2008/096699	配向カーボンナノチューブの製造装置および製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
51	WO2008/096806	銀ナノクラスター含有微細中空繊維状有機ナノチューブ及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
52	WO2008/102782	毛髪成長阻害剤	独立行政法人産業技術総合研究所
53	WO2008/102783	発毛促進剤	独立行政法人産業技術総合研究所
54	WO2008/102813	カーボンナノチューブからなる梁状体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所